

第3【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第2四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第2四半期連結会計期間において、前連結会計年度末日時点の計画から設備の新設、除却等の計画について、昨今の厳しい事業環境に鑑み、デバイスソリューションを中心に20,000百万円減額し、220,000百万円としました。当社の主力ビジネスであるテクノロジーソリューションにおいては10,000百万円増額し、110,000百万円としました。これは、主に、国内の主要拠点である富士通ソリューションスクエア（東京都大田区）の土地及び建物について、平成15年度に不動産の流動化を実施し、信託受益権の対象不動産の所有者から賃借（リースバック）を受けておりましたが、平成20年9月30日に、当該信託受益権を取得する契約を締結したことによるものです。事業の種類別セグメントごとの内訳は次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称	金額 (百万円)	設備等の主な内容・目的
テクノロジーソリューション	110,000	国内データセンター設備及び英国におけるアウトソーシング設備
ユビキタスプロダクトソリューション	25,000	垂直磁気記録方式HDD製造設備及び携帯電話製造設備
デバイスソリューション	55,000	先端ロジックLSI製造設備及び基盤ロジックLSI製造設備
その他、全社（共通）	30,000	オーディオ・ナビゲーション機器、移動通信機器及び自動車用電子機器の開発・製造設備
計	220,000	

- (注) 1. 所要資金220,000百万円は、自己資金により充当する予定です。
2. 設備投資の計画額は、消費税抜きで表示しております。
3. 経常的な設備の更新のための除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。
4. 全社（共通）は、一般管理部門及び共通研究費等のセグメントに配賦不能な設備投資額です。